การศึกษาความต้านทานของฟิล์มโพลีซิลิคอน และอมอร์ฟัสซิลิคอน หลังกระบวนการยิงฝังประจุเพื่อใช้ในอุปกรณ์ตรวจจับความดัน

STUDY OF POLY-Si AND a-Si FILM RESISTANCE AFTER IMPLANTATION PROCESS FOR PRESSURE SENSOR

การุณ แซ่จอก

KAROON SAEJOK

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมไมโครอิเล็กทรอนิกส์

บัณฑิตวิทยาลัย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

พ.ศ.2550

STUDY OF POLY-Si AND a-Si FILM RESISTANCE AFTER IMPLANTATION PROCESS FOR PRESSURE SENSOR

KAROON SAEJOK

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT

OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE OF

MASTER OF ENGINEERING IN MICROELECTRONICS ENGINEERING

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG

2007

COPYRIGHT 2007

SCHOOL OF GRADUATE STUDIES

KING MONGKUT'S INSTITUTE OF TECHNOLOGY LADKRABANG